

HY-OPTIMA™ 2700シリーズ防爆オンライン水素計

H2scan社製HY-OPTIMA™ 2700シリーズは、半導体センサー(Pd/Ni)を使用した、プロセスに設置し水素をリアルタイムで測定する分析計です。60℃までのプロセスガスに対応可能で、水素のみに反応するため、複数のバックグラウンドガス中で使用できます。正確なリアルタイム測定により、プロセスプラントの効率化、診断、保守管理の向上がもたらされ、水素製造設備や石油化学アプリケーションに最適です。

| | |
|---------|--|
| 推奨点検間隔 | 90日 |
| 製品寿命 | 10年 (保証期間ではありません。 ご使用環境、プロセスによります) |
| 現場校正 | 可能 |
| 圧力補正 | 外部圧力センサーにより可能(1) |
| サンプル湿度 | <95%RH(結露の無いこと) |
| サンプル流量 | 0.1~10L/m |
| サンプル温度 | -20℃~60℃ |
| 周囲温度 | -20℃~55℃ |
| 保管時の温度 | -30℃~80℃ |
| 出力信号 | アナログ: 4-20mA シリアル: RS232またはS422 リレー接点(2): 5A/240VACまたは5A/30VDC |
| 電源電圧 | 90VAC~240VAC |
| 消費電力 | 15W |
| 寸法・重量 | W: 138mm, L: 192mm, D: 144mm 重量: 2.7kg |
| アダプター継手 | 3/4"ユニオンティー継手 |



防爆規格

| | 2700シリーズ | リモコン |
|------|---|---|
| TIIS | Ex d IIB + H2T4 Max Gas Pressure: 10kpaG | Ex ia IICT4 |
| UL | Class 1, Division 1, Groups B, C, D UL508, 1203 | Class 1, Division 1, Groups A, B, C, D UL913 |
| ATEX | DEMKO_11_ATEX1107270X II 2 G Exd IIB + H2 T4 Gb Max Gas Pressure: 1.1 ATM(10kpaG) Max Ambient Temperature: 55℃ | DEMKO_11_ATEX8175718 II 1 G Ex ia IIC T4 |
| GSA | GSA-22.2 No.30-M1986(R2012) | CAN/GSA C22.2 No.157-92 |

- ATEX, TIISは最大圧力が1.1ATM(10kPaG)までとなります。
- 設定可能な2つの接点および1つのフォルト接点

2700シリーズは測定範囲や腐食性ガス、通常の水素濃度に応じて下記のような機種をご用意しております。

| 型式 | 測定範囲 | H ₂ が常時存在 | CO限度 | H ₂ S限度 | 最大圧力(MPa)(1) | 応答性(T90)秒 | 精度(5)(絶対値) | | ドリフト/週(5)(絶対値) | | 繰り返し性(5)(絶対値) | | 直線性(5)(絶対値) | | 校正バックグラウンドガス |
|------|----------|----------------------|---------|--------------------|--------------|-----------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------------|
| | | | | | | | 10% H ₂ 以下 | 10% ~ 100% | 10% H ₂ 以下 | 10% ~ 100% | 10% H ₂ 以下 | 10% ~ 100% | 10% H ₂ 以下 | 10% ~ 100% | |
| 2710 | 0.1~10% | Yes | <100ppm | <20ppm | 0.1 | <90 | 0.15 | NA | 0.15 | NA | 0.15 | NA | 0.15 | NA | N ₂ |
| 2720 | 0.4~5% | No(3) | 0 | 0 | 0.2 | <60 | ±0.3 | NA | 0.3 | NA | 0.3 | NA | 0.3 | NA | O ₂ , N ₂ |
| 2730 | 0.5~100% | Yes | <100ppm | <1000ppm | 0.2 | <60 | ±0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | N ₂ |
| 2740 | 0.5~100% | Yes | 20% | 3%(4) | 0.2 | <90 | ±0.3 | 1.0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | N ₂ |

- 2720B型のバックグラウンドガスは、空気、O₂またはN₂となります。
- 特殊仕様により10%H₂Sまでの濃度に適応したセンサーも可能です。
- センサーの精度は乾燥したプロセスで25℃、圧力が一定の状態において保証されます。校正ガスの精度にも影響されます。精度はシリアルポートかデジタルディスプレイの出力による値です。